

NIMS微細加工共用設備 利用料金表 (内部利用)

※2024年4月1日より適用

(税抜表示)

No.	装置リスト	NIMS利用者 データ提供あり及び データ提供非対応 (NIMS所属かつNIMS予算での支出に限る)			NIMS利用者 データ提供なし (NIMS所属かつNIMS予算での支出に限る)		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	¥11,000	¥14,200	¥17,400	¥16,500	¥21,300	¥26,100
2	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥11,000	¥14,200	¥17,400	¥16,500	¥21,300	¥26,100
3	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥6,600	¥9,800	¥13,000	¥9,900	¥14,700	¥19,500
4	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
5	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
6	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
7	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
8	マスクアライナー [MA-6]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
10	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
11	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
12	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
15	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
16	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
17	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
18	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
19	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
20	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
21	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
22	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
23	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
24*	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
25	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
26	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
27	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
28	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
29	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
30	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
31	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
32	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
33	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
34	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
35	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
36	FE-SEM [S-4800]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
37	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
38	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
39	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥4,400	¥7,600	¥10,800	¥6,600	¥11,400	¥16,200
40	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
41*	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
42*	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
43*	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
44*	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
45*	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
46*	触針式プロファイラー [Dektak XT-A]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
47*	触針式プロファイラー [Dektak 6M]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
48*	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
49*	分光エリブソメーター [M2000]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
50*	分光エリブソメーター [UNECs-2000A]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
51*	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
52*	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
53*	ダイシングソー [DAD322]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
54*	ダイシングソー [DAD3220]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
55*	室温ブローバー [MX-200/B]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
56*	室温ブローバー [HMP-400]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
57*	低温ブローバー [GRAIL-408-32-B]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
58*	液体窒素ブローバー [SB-LN2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
59*	ワイヤーボンダー [7476D #1]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
60*	ワイヤーボンダー [7476D #2]	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
61*	ウェットステーション	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
62*	CAD作成システム	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900
63*	クリーンルーム	¥2,200	¥5,400	¥8,600	¥3,300	¥8,100	¥12,900

*装置単体でのデータ登録非対応装置

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価(税抜)であり、これに利用時間(※)を乗じます。
 - 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
- ※ 利用時間は、装置予約時間(=装置占有時間:装置の立ち上げ/終了作業時間含む)です。